

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
【部門区分】第 6 部門第 2 区分
【発行日】令和 1 年 6 月 27 日 (2019.6.27)

【公表番号】特表 2018-518706 (P2018-518706A)
【公表日】平成 30 年 7 月 12 日 (2018.7.12)
【年通号数】公開・登録公報 2018-026
【出願番号】特願 2017-560236 (P2017-560236)
【国際特許分類】

G 0 2 B 27/02 (2006.01)

G 0 2 B 6/00 (2006.01)

【F I】

G 0 2 B 27/02 Z

G 0 2 B 6/00 D

【手続補正書】

【提出日】令和 1 年 5 月 20 日 (2019.5.20)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

装置であって、

対向する平面入力および出力面を有する第 1 の導波管と、

前記第 1 の導波管を横断して形成された回折光学要素 (DOE) であって、前記 DOE は、光を前記導波管に結合させるためのものであり、前記導波管に結合された前記光は、全内部反射を介して、前記導波管上の出射場所に指向される、DOE と、

前記第 1 の導波管の前記出射場所から出射する光を捕捉するためにそこに隣接して位置付けられた入力を有し、かつ、それに対応する出力信号を生成する、光センサであって、前記第 1 の導波管の前記出射場所に対する前記光センサの角度および位置は、移動可能であり、プロセッサの制御下にある、光センサと

を備える、装置。

【請求項 2】

前記第 1 の導波管と整合された狭帯域波長フィルタをさらに含む、請求項 1 に記載の装置。

【請求項 3】

対向する平面入力および出力面を有する第 2 の導波管であって、前記第 2 の導波管は、前記第 1 の導波管と整合され、前記第 1 の導波管に平行である、第 2 の導波管と、

前記第 2 の導波管を横断して形成された DOE であって、前記 DOE は、前記第 2 の導波管の面を横断する場所において反射率のレベルを制御するためのものである、DOE と、

光を前記第 2 の導波管に投入するために、前記第 2 の導波管に隣接して位置付けられた出力を有する光発生器であって、プロセッサは、前記第 2 の導波管に投入される前記光を制御し、全内部反射を介して前記第 2 の導波管に入射する光を誘導し、前記第 2 の導波管の前記出力面を横断する特定の場所において前記導波管から出射させる、光発生器と

をさらに備える、請求項 1 に記載の装置。

【請求項 4】

前記第 1 の導波管の縁に沿って延在する第 3 の導波管をさらに含み、前記第 3 の導波管

は、前記第 1 の導波管の前記出射場所から出射する光を捕捉し、前記光を前記センサに送達するためのものである、請求項 1 に記載の装置。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0031

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0031】

本装置はさらに、第 1 の導波管の縁に沿って延在する、第 3 の導波管を含み得る。第 3 の導波管は、第 1 の導波管の出射場所から出射する光を捕捉し、光をセンサに送達し得る。

本願明細書は、例えば、以下の項目も提供する。

(項目 1)

装置であって、

対向する平面入力および出力面を有する第 1 の導波管と、

前記第 1 の導波管を横断して形成された回折光学要素 (DOE) であって、前記 DOE は、前記導波管を通過する光の一部を前記導波管に結合させるためのものであり、前記導波管に結合された光は、全内部反射を介して、前記導波管上の出射場所に指向される、DOE と、

前記第 1 の導波管の出射場所から出射する光を捕捉するためにそこに隣接して位置付けられた入力を有し、かつ、それに対応する出力信号を生成する、光センサとを備える、装置。

(項目 2)

前記第 1 の導波管と整合された狭帯域波長フィルタをさらに含む、項目 1 に記載の装置。

(項目 3)

前記第 1 の導波管の出射場所に対する前記センサの角度および位置は、移動可能であり、プロセッサの制御下にある、項目 1 に記載の装置。

(項目 4)

対向する平面入力および出力面を有する第 2 の導波管であって、前記第 2 の導波管は、前記第 1 の導波管と整合され、前記第 1 の導波管に平行である、第 2 の導波管と、

前記第 2 の導波管を横断して形成された DOE であって、前記 DOE は、前記第 2 の導波管の面を横断する場所において反射率のレベルを制御するためのものである、DOE と、

光を前記第 2 の導波管に投入するために、前記第 2 の導波管に隣接して位置付けられた出力を有する光発生器であって、プロセッサは、前記第 2 の導波管に投入される光を制御し、全内部反射を介して前記第 2 の導波管に入射する光を誘導し、前記第 2 の導波管の出力面を横断する特定の場所において前記導波管から出射させる、光発生器と

をさらに備える、項目 1 に記載の装置。

(項目 5)

前記第 1 の導波管の縁に沿って延在する第 3 の導波管をさらに含み、前記第 3 の導波管は、前記第 1 の導波管の出射場所から出射する光を捕捉し、前記光を前記センサに送達するためのものである、項目 1 に記載の装置。